



Japio-GPG/FX

Japio世界特許情報全文検索サービス

新機能リリース

(2015年7月31日リリース予定)

株式会社発明通信社
一般財団法人日本特許情報機構



拡張機能

- o (1)中国機械翻訳未知語かぶせ機能
- o (2)全言語検索機能
- o (3)PCTミニドク国・機関選択機能
- o (4)ファミリー除外機能
- o (5)Espacenetリンク機能
- o (6)サマリー表示機能
- o ・検索クエリー指定方法の改善
- o ・ハイライト機能の改善
- o ・表示機能の改善



(1) 中日機械翻訳未知語かぶせ機能

～機能説明～

Japio-GPG/FXでは、中日機械翻訳処理において翻訳ができない用語(未知語)が発生した場合は、未知語(中国語)を【】(墨付きカッコ)で括り表示しています。

本機能では、Japio独自の中日用語テーブルを利用し、未知語を日本語に置き換えて表示します。

1. 表示時に日本語に置き換えられた用語は《》で括られて表示されます。
2. 日本語に置き換えられた用語にマウスのカーソルを重ねると置き換え前の用語(中国語)が表示されます。

《注意》

1. 本機能で置き換えられた日本語は検索ではヒットしません。
2. 置き換えられる前の用語(中国語)で検索した場合は、本機能は動作せず、中国語が表示されます。

(1) 中日機械翻訳未知語かぶせ機能 ～画面例～

<p>0中的与安装有拍摄芯片 0中的安装有拍摄芯片 基板120具有从该芯基板 的宽度是例如上述的一側 是123的宽度短。延伸部</p>	<p>側面)外側に延在する方向をx軸正(+)方向, x軸+方向と反対の方向にx軸負方向として(-)方向。</p> <p>チップ撮像100コア基板実装120。ここで(図示なし), しかしコア基板120における実装撮像チップ100られる面とは反対側の面に電子部品が実装されている。この明細書で, コア基板120における装着撮像チップ100面をチップ実装面として, 電子部品の面を取り付け面が装着されている。コア基板120 このコア基板の一方の側面から(紙面の右側側面)をx軸+方向へ延びる延《延部》151。延出部151その幅は例えば上述した一側面のy軸方向の幅の半分程度。すなわち、延出部151の幅は後述するコア層123の幅よりも短い。《延部》遅延151上記の側面におけるy軸方向の中央部分から延びる。</p>
---	---

本機能にて置き換えられた日本語表示です。

マウスのカーソルを重ねるとかぶせ前の用語(中国語)が表示されます。



(2)全言語検索機能 ～機能説明～

Japio-GPG/FXでは日本語・英語・中国語のみ検索対象としていましたが、新たにフランス語や韓国語など、データベースに蓄積されている言語全てを検索できるようにしました。

1. 項目検索画面では全ての原語を混在して指定することができます。
2. 検索クエリで指定できる全言語用の検索タームを新設しました。
 1. タイトル : TI (蓄積されている全てのデータのタイトルを検索)
 2. 要約 : AB (蓄積されている全てのデータのタイトルを検索)
 3. クレーム : CL (中国公報(中国語)のクレームを除き検索)
 4. 詳細な説明 : DS (中国公報(中国語)の詳細な説明を除き検索)
 5. 上記4項目全て: AL

《注意》

1. PCT公報の言語の内、下記言語のインデックスの作成規則は以下の通りです。
韓国語…スペース区切り、中国語・日本語…1Nグラム



(2) 全言語検索機能

～画面例～

検索項目	検 索	ク リ ア	入 力 例
<input checked="" type="checkbox"/> 発明の名称 (TI)	プリンタ+printer+Drucker+imprimeur+打印机+프린터		AND演算 inkjet printer インクジェット プリンタ インクジェット inkjet OR演算 laser+inkjet レーザー+インクジェット インクジェット+inkjet ※中国・日本クレームは英語データ無し
<input checked="" type="checkbox"/> 要約 (AB)			
<input type="checkbox"/> クレーム (CL)			
<input type="checkbox"/> 詳細な説明 (DS)			

日本語・英語・中国語の他、独語、仏語、韓国語などの指定が可能です。

検索クエリー	検 索	ク リ ア
TI:(プリンタ+printer+Drucker+imprimeur+打印机+프린터)	ABJ:インクジェット AND ABJ:プリンタ IC:A01B* AND (ABJ:インクジェット OR ABE:inkjet) ※演算子(AND,OR,NOT)は大文字	

全言語用の検索ターム(TI等)を利用して検索します。

※検索式の指定方法も改善しました。詳細は次ページ以降をご参照ください。

(3)PCTミニドク国・機関選択機能 ～機能説明&画面例～

PCTミニドク国および機関を対象とした検索を行う場合、国・機関指定をワンクリックで選択できる機能です。

○ PCTミニドク国および機関

- | | |
|------------------------|------------------------|
| <u>1 AP (ARIPO)</u> | <u>11 FR (フランス)</u> |
| <u>2 AT (オーストリア)</u> | <u>12 GB (イギリス)</u> |
| <u>3 AU (オーストラリア)</u> | <u>13 JP (日本)</u> |
| <u>4 CA (カナダ)</u> | <u>14 KR (大韓民国)</u> |
| <u>5 CH (スイス)</u> | <u>15 OA (OAPI)</u> |
| <u>6 CN (中国)</u> | <u>16 RU (ロシア連邦)</u> |
| <u>7 DD (ドイツ民主共和国)</u> | <u>17 SU (ソビエト連邦)</u> |
| <u>8 DE (ドイツ)</u> | <u>18 US (アメリカ合衆国)</u> |
| <u>9 EA (EAPO)</u> | <u>19 WO (WIPO)</u> |
| <u>10 EP (EPO)</u> | |

5行 + PCT 選択/選択解除		(CP)
国指定選択 クリア		出願日 (AD)
AP AT AU CA CH CN DD DE EA EP FR GB JP KR OA RU SU US WO		公報発行日 (PD)
		出願番号 (AN)
		文献番号 (PN)
		優先権主張番号 (PR)
<input checked="" type="checkbox"/> PCTミニドク国・機関		
検索クエリー		

PCTミニドク国・機関をチェックします。



(4) ファミリー除外機能 ～機能説明&画面例～

検索結果の回答から、パテントファミリーに含まれる国を指定して、除外する機能です。

除外指定が可能な国は5庁+PCTです。

代表ファミリー表示
日本語代表表示(J)
英語代表表示(E)
非英語代表表示(N)

☒JP ☒US ☐EP
☐PCT ☐CN ☐KR
ファミリー除外

1. **RESOURCE ELEMENT MAPPING FOR WIRELESS TRANSMISSIONS**
【E J】無線送信用のリソースエレメント・マッピング

出願人：英特尔公司
(INTEL CORP(INTEL CORPORATION))

発明者：J.曹; S.张
(CAO JINYU; ZHANG SENJIE(CAO JINYU; ZHANG SENJIE))

出願番号：CN201280072867.7 (CN2012872867) [2012-06-01]
文献番号：[CN104255076A \(CN104255076A\)](#) [2014-12-31]
IPC：H04W72/04[200601](H04W72/04)

要約(日)：【E J】基地局とユーザ装置デバイスの間の無線送信はリソースマッピング規則を使用して行なわれ、リソースブロック説明に基づいて生成されてもよい。リソースブロック説明は、シンボルタイプの定義済みのシンボルとの一致により決定されてもよい。シンボルタイプは伝送特性に基づいて決定されてもよい。

パテントファミリー： **ファミリー一覧表示**
・ [WO2013177788A1 E](#) ・ [US2014119330A1](#) ・ [CN104255076A](#) ・ [EP2856818A1](#)

国・機関をチェックして
「ファミリー除外」ボタンを
押します。



(5) Espacenetリンク機能 ～機能説明&画面例～

詳細表示画面から、Espacenetの検索画面を開くリンクを追加しました。

Japio世界特許情報全文検索サービス Japio-GPG /FX

| 簡易検索 | マニュアル | ポータル | 経過情報(最新・履歴) | しおり表示 | 検索式表示 | 検索履歴表示 | 検索支援(用語・出願人・発明者) | 翻訳Webサービス |

検索 > 一覧表示 (((TI:特許番号 OR AB:特許番号 OR ... > PY:2014 > 詳細表示

300,149件中1件目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>

Espacenet 全図表示 ファイル出力 ダウンロード

書誌+全文(全言語・EJ・J表示)

1.
用于无线传送的资源元素映射
RESOURCE ELEMENT MAPPING FOR WIRELESS TRANSMISSIONS
【E J】無線送信用のリソースエレメント・マッピング
出願人: 英特尔公司
(INTEL CORP(INTEL CORPORATION))
発明者: J.曹; S.張
(CAO JINYU; ZHANG SENJIE(CAO JINYU; ZHANG SENJIE))
出願番号: CN201280072867.7(CN2012872867) [2012-06-01]
文献番号: CN104255076A (CN104255076A) [2014-12-31] [公報PDF](#) [フロントPDF](#)
IPC: H04W72/04[200601](H04W72/04)
ECLA:
CPC: H04W72/042; H04W72/1263
優先権主張番号: WO2012CN76370

別ウインドウで
Espacenet検索画面
(日本語)が開きます。

図 1: Espacenet検索画面のスクリーンショット。検索条件として「plastic and bicycle」が入力されている。検索結果のリストが表示されている。

図 2: Espacenet検索画面のスクリーンショット。検索条件として「hair」が入力されている。検索結果のリストが表示されている。



(6) サマリー表示機能 ～機能説明&画面例～

発明通信社のサマリーをPDF形式で表示します。
日本とアメリカの文献のみです。

31,281,410件中1件目

Esapenet 全画面表示 ファイル出力 ダウンロード

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

書誌+全文(全言語・EJ・CI表示) 表示

1.
[J] the radio charging apparatus for cable type secondary batteries
【公報】ケーブル型二次電池用の無線充電装置
出願人: エルジー・ケム・リミテッド
発明者: クォン、ヨハン・ウ、サン・ウク; チュン、ヘラン; キム、ジニョン
出願番号: JP2015513959 [2014-03-25]
文献番号: JP20155172977 [2015-06-18] 公報PDF フロントPDF サマリーPDF
IPC: H02J7/00[200601]; H02J17/00[200601]
ECLA:
CPC:
優先権主張番号:

英語/中国語
<invention-title>
[J] the radio charging apparatus for cable type secondary batteries
<abstract>
[J] The present invention indicates the radio charging apparatus for cable type secondary batteries. [the radio charging apparatus for cable type secondary battery] by the present invention [In order to equip with a cable type secondary battery, [the space formed in the inside] The socket which it has; the 1st terminal electrically connected with the external collector of the cable type secondary battery with which the inside of the above-mentioned socket was equipped; The 2nd terminal, electrically connected with the internal collector of the cable type secondary battery with which the inside of the above-mentioned socket was equipped, and an end are connected with said 1st terminal. The other end is connected with said 2nd terminal, and contains secondary-coil; for radio charge currently wound over the circumferential surface of the above-mentioned socket. According to the present invention, also when there is no secondary coil for a radio-power reception in a cable type secondary

「サマリーPDF」ボタンを
押します。

公開サマリー

1. 書誌事項
2. 出願人要約
3. 産業上の利用分野または技術分野
4. 請求の範囲
5. 作用
6. 図面の簡単な説明・符号の説明
7. 図面

登録サマリー

1. 書誌事項
2. 産業上の利用分野
3. 目的または効果
4. 請求の範囲
5. 作用
6. 図面の簡単な説明・符号の説明
7. 図面



(6)サマリー表示機能

～画面例 (JP公開特許サマリー)～

公開特許サマリー

特開2015-1

(3/全 38頁)

審査請求 未請求 請求書の数 6

(48)公開日 平成27年(2015) 1月 31日

(53)Int. Cl.

A 01 K 67/027 (2006.01)

A 01 N 33/15 (2006.01)

G 01 N 33/50 (2006.01)

C 12 N 15/09 (2006.01)

A 01 K 67/027 ZNA

G 01 N 33/15 Z

C 12 N 15/00 A

(21)特開2013-124206

(22)出願平成25年(2013) 6月12日

(71)出 願 人 株式会社明治

(72)発 明 者 利光 孝之

(72)発 明 者 上原 史恵

(72)発 明 者 池上 秀二

(72)発 明 者 伊藤 裕之

東京都江東区新砂1丁目2番10号

株式会社明治研究本部内

神奈川県小田原市成田5-4-0

株式会社明治研究本部内

神奈川県小田原市成田5-4-0

株式会社明治研究本部内

神奈川県小田原市成田5-4-0

株式会社明治研究本部内

【発明の名称】

過敏性腸症候群モデル動物の作成方法

「図表あり」

(57)【要約】

【課題】

本発明の課題は、慢性的な下痢を誘導した過敏性腸症候群下痢型モデル動物を作成する方法を提供することである。

【解決手段】

本発明者らは、免疫低下によって腸内細菌の異常増殖おきること、および腸内細菌の異常増殖が過敏性腸症候群下痢型の発症につながることに着目した。このことから、動物に免疫抑制剤を投与することで慢性的な下痢が誘導されることを見出し、本発明を完成させた。

【技術分野】

本発明は、下痢型の過敏性腸症候群モデル動物の作成方法、および下痢型の過敏性腸症候群の治療に有効なプロバイオティクスに関する。

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、慢性的な下痢を誘導した過敏性腸症候群下痢型モデル動物を作成する方法を提供することである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

非ヒト哺乳動物に、免疫抑制剤を投与することを特徴とする、慢性の下痢を誘導する方法。

【請求項2】

請求項1に記載の方法により得られる、慢性の下痢が誘導された、過敏性腸症候群下痢型モデル動物。

【請求項3】

請求項1に記載の方法により、慢性の下痢が誘導された非ヒト哺乳動物を得ることを含む、過敏性腸症候群下痢型モデル動物の作成方法。

【請求項4】

請求項3に記載の方法により過敏性腸症候群下痢型モデル動物を作成し、その過敏性腸症候群下痢型モデル動物に試験物質を投与し、さらに該動物における、下痢症状、腸運動性、内臓感覚過敏からなる群から選ばれた少なくとも1種類以上を評価することを含む、過敏性腸症候群下痢型モデル動物の作成方法。

【請求項5】

特開2015-1

請求項1に記載の方法により得られる、慢性の下痢が誘導された、免疫不全疾患による下痢のモデル動物。

【請求項6】

請求項1に記載の方法により得られる、慢性の下痢が誘導された非ヒト哺乳動物を得ることを含む、免疫不全疾患による下痢のモデル動物の作成方法。

「書誌事項の続き」

【キーワード(参考)】

26045

48024

【Fターム(参考)】

26045 AA29

48024 AA11 CA09 HA12

【図面の簡単な説明】

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】

【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】

【図17】

【図18】

【図19】

【図20】

【図21】

【図22】

【図23】

【図24】

【図25】

【図26】

【図27】

【図28】

【図29】

【図30】

【図31】

【図32】

【図33】

【図34】

【図35】

【図36】

【図37】

【図38】

【図39】

【図40】

【図41】

【図42】

【図43】

【図44】

【図45】

【図46】

【図47】

【図48】

【図49】

【図50】

【図51】

【図52】

【図53】

【図54】

【図55】

【図56】

【図57】

【図58】

【図59】

【図60】

【図61】

【図62】

【図63】

【図64】

【図65】

【図66】

【図67】

【図68】

【図69】

【図70】

【図71】

【図72】

【図73】

【図74】

【図75】

【図76】

【図77】

【図78】

【図79】

【図80】

【図81】

【図82】

【図83】

【図84】

【図85】

【図86】

【図87】

【図88】

【図89】

【図90】

【図91】

【図92】

【図93】

【図94】

【図95】

【図96】

【図97】

【図98】

【図99】

【図100】

【図101】

【図102】

【図103】

【図104】

【図105】

【図106】

【図107】

【図108】

【図109】

【図110】

【図111】

【図112】

【図113】

【図114】

【図115】

【図116】

【図117】

【図118】

【図119】

【図120】

【図121】

【図122】

【図123】

【図124】

【図125】

【図126】

【図127】

【図128】

【図129】

【図130】

【図131】

【図132】

【図133】

【図134】

【図135】

【図136】

【図137】

【図138】

【図139】

【図140】

【図141】

【図142】

【図143】

【図144】

【図145】

【図146】

【図147】

【図148】

【図149】

【図150】

【図151】

【図152】

【図153】

【図154】

【図155】

【図156】

【図157】

【図158】

【図159】

【図160】

【図161】

【図162】

【図163】

【図164】

【図165】

【図166】

【図167】

【図168】

【図169】

【図170】

【図171】

【図172】

【図173】

【図174】

【図175】

【図176】

【図177】

【図178】

【図179】

【図180】

【図181】

【図182】

【図183】

【図184】

【図185】

【図186】

【図187】

【図188】

【図189】

【図190】

【図191】

【図192】

【図193】

【図194】

【図195】

【図196】

【図197】

【図198】

【図199】

【図200】

【図201】

【図202】

【図203】

【図204】

【図205】

【図206】

【図207】

【図208】

【図209】

【図210】

【図211】

【図212】

【図213】

【図214】

【図215】

【図216】

【図217】

【図218】

【図219】

【図220】

【図221】

【図222】

【図223】

【図224】

【図225】

【図226】

【図227】

【図228】

【図229】

【図230】

【図231】

【図232】

【図233】

【図234】

【図235】

【図236】

【図237】

【図238】

【図239】

【図240】

【図241】

【図242】

【図243】

【図244】

【図245】

【図246】

【図247】

【図248】

【図249】

【図250】

【図251】

【図252】

【図253】

【図254】

【図255】

【図256】

【図257】

【図258】

【図259】

【図260】

【図261】

【図262】

【図263】

【図264】

【図265】

【図266】

【図267】

【図268】

【図269】

【図270】

【図271】

【図272】

【図273】

【図274】

【図275】

【図276】

【図277】

【図278】

【図279】

【図280】

【図281】

【図282】

【図283】

【図284】

【図285】

【図286】

【図287】

【図288】

【図289】

【図290】

【図291】

【図292】

【図293】

【図294】

【図295】

【図296】

【図297】

【図298】

【図299】

【図300】

【図301】

【図302】

【図303】

【図304】

【図305】

【図306】

【図307】

【図308】

【図309】

【図310】

【図311】

【図312】

【図313】

【図314】

【図315】

【図316】

【図317】

【図318】

【図319】

【図320】

【図321】

【図322】

【図323】

【図324】

【図325】

【図326】

【図327】

【図328】

【図329】

【図330】

【図331】

【図332】

【図333】

【図334】

【図335】

【図336】

【図337】

【図338】

【図339】

【図340】

【図341】

【図342】

【図343】

【図344】

【図345】

【図346】

【図347】

【図348】

【図349】

【図350】

【図351】

【図352】

【図353】

【図354】

【図355】

【図356】

【図357】

【図358】

【図359】

【図360】

【図361】

【図362】

【図363】

【図364】

【図365】

【図366】

【図367】

【図368】

【図369】

【図370】

【図371】

【図372】

【図373】

【図374】

【図375】

【図376】

【図377】

【図378】

【図379】

【図380】

【図381】

【図382】

【図383】

【図384】

【図385】

【図386】

【図387】

【図388】

【図389】

【図390】

【図391】

【図392】

【図393】

【図394】

【図395】

【図396】

【図397】

【図398】

【図399】

【図400】

【図401】

【図402】

【図403】

【図404】

【図405】

【図406】

【図407】

【図408】

【図409】

【図410】

【図411】

【図412】

【図413】

【図414】

【図415】

【図416】

【図417】

【図418】

【図419】

【図420】

【図421】

【図422】

【図423】

【図424】

【図425】

【図426】

【図427】

【図428】

【図429】

【図430】

【図431】

【図432】

【図433】

【図434】

【図435】

【図436】

【図437】

【図438】

【図439】

【図440】

【図441】

【図442】

【図443】

【図444】

【図445】

【図446】

【図447】

【図448】

【図449】

【図450】

【図451】

【図452】

【図453】

【図454】

【図455】

【図456】

【図457】

【図458】

【図459】

【図460】

【図461】

【図462】

【図463】

【図464】

【図465】

【図466】

【図467】

【図468】

【図469】

【図470】

【図471】

【図472】

【図473】

【図474】

【図475】

【図476】

【図477】

【図478】

【図479】

【図480】

【図481】

【図482】

【図483】

【図484】

【図485】

【図486】

【図487】

【図488】

【図489】

【図490】

【図491】

【図492】

【図493】

【図494】

【図495】

【図496】

【図497】

【図498】

【図499】

【図500】

【図501】

【図502】

【図503】

【図504】

【図505】

【図506】

【図507】

【図508】

【図509】

【図510】

【図511】

【図512】

【図513】

【図514】

【図515】

【図516】

【図517】

【図518】

【図519】

【図520】

【図521】

【図522】

【図523】

【図524】

【図525】

【図526】

【図527】

【図528】

【図529】

【図530】

【図531】

【図532】

【図533】

【図534】

【図535】

【図536】

【図537】

【図538】

【図539】

【図540】

【図541】

【図542】

【図543】

【図544】

【図545】

【図546】

【図547】

【図548】

【図549】

【図550】

【図551】

【図552】

【図553】

【図554】

【図555】

【図556】

【図557】

【図558】

【図559】

【図560】

【図561】

【図562】

【図563】

【図564】

【図565】

【図566】

【図567】

【図568】

【図569】

【図570】

【図571】

【図572】

【図573】

【図574】

【図575】

【図576】

【図577】

【図578】

【図579】

【図580】

【図581】

【図582】

【図583】

【図584】

【図585】

【図586】

【図587】

【図588】

【図589】

【図590】

【図591】

【図592】

【図593】

【図594】

【図595】

【図596】

【図597】

【図598】

【図599】

【図600】

【図601】

【図602】

【図603】

【図604】

【図605】

【図606】

【図607】

【図608】

【図609】

【図610】

【図611】

【図612】

【図613】

【図614】

【図615】

【図616】

【図617】

【図618】

【図619】

【図620】

【図621】

【図622】

【図623】

【図624】

【図625】

【図626】

【図627】

【図628】

【図629】

【図630】

【図631】

【図632】

【図633】

【図634】

【図635】

【図636】

【図637】

【図638】

【図639】

【図640】

【図641】

【図642】

【図643】

【図644】

【図645】

【図646】

【図647】

【図648】

【図649】

【図650】

【図651】

【図652】

【図653】

【図654】

【図655】

【図656】

【図657】

【図658】

【図659】

【図660】

【図661】

【図662】

【図663】

【図664】

【図665】

【図666】

【図667】

【図668】

【図669】

【図670】

【図671】

【図672】

【図673】

【図674】

【図675】

【図676】

【図677】

【図678】

【図679】

【図680】

【図681】

【図682】

【図683】

【図684】

【図685】

【図686】

【図687】

【図688】

【図689】

【図690】

【図691】

【図692】

【図693】

【図694】

【図695】

【図696】

【図697】

【図698】

【図699】

【図700】

【図701】

【図702】

【図703】

【図704】

【図705】

【図706】

【図707】

【図708】

【図709】

【図710】

【図711】

【図712】

【図713】

【図714】

【図715】

【図716】

【図717】

【図718】

【図719】

【図720】

【図721】

【図722】

【図723】

【図724】

【図725】

【図726】

【図727】

【図728】

【図729】

【図730】

【図731】

【図732】

【図733】

【図734】

【図735】

【図736】

【図737】

【図738】

【図739】

【図740】

【図741】

【図742】

【図743】

【図744】

【図745】

【図746】

【図747】

【図748】

【図749】

【図750】

【図751】

【図752】

【図753】

【図754】

【図755】

【図756】

【図757】

【図758】

【図759】

【図760】

【図761】

【図762】

【図763】

【図764】

【図765】

【図766】

【図767】

【図768】

【図769】

【図770】

【図771】

【図772】

【図773】

【図774】

【図775】

【図776】

【図777】

【図778】

【図779】

【図780】

【図781】

【図782】

【図783】

【図784】

【図785】

【図786】

【図787】

【図788】

【図789】

【図790】

【図791】

【図792】

【図793】

【図794】

【図795】

【図796】

【図797】

【図798】

【図799】

【図800】

【図801】

【図802】

【図803】

【図804】

【図805】

【図806】

【図807】

【図808】

【図809】

【図810】

【図811】

【図812】

【図813】

【図814】

【図815】

【図816】

【図817】

【図818】

【図819】

【図820】

【図821】

【図822】

【図823】

【図824】

【図825】

【図826】

【図827】

【図828】

【図829】

【図830】

【図831】

【図832】

【図833】

【図834】

【図835】

【図836】

【図837】

【図838】

【図839】

【図840】

【図841】

【図842】

【図843】

【図844】

【図845】

【図846】

【図847】

【図848】

【図849】

【図850】

【図851】

【図852】

【図853】

【図854】

【図855】

【図856】

【図857】

【図858】

【図859】

【図860】

【図861】

【図862】

【図863】

【図864】

【図865】

【図866】

【図867】

【図868】

【図869】

【図870】

【図871】

【図872】

【図873】

【図874】

【図875】

【図876】

【図877】

【図878】

【図879】

【図880】

【図881】

【図882】

【図883】

【図884】

【図885】

【図886】

【図887】

【図888】

【図889】

【図890】

【図891】

【図892】

【図893】

【図894】

【図895】

【図896】

【図897】

【図898】

【図899】

【図900】

【図901】

【図902】

【図903】

【図904】

【図905】

【図906】

【図907】

【図908】

【図909】

【図910】

【図911】

【図912】

【図913】

【図914】

【図915】

【図916】

【図917】

【図918】

【図919】

【図920】

【図921】

【図922】

【図923】

【図924】

【図925】

【図926】

【図927】

【図928】

【図929】

【図930】

【図931】

【図932】

【図933】

【図934】

【図935】

【図936】

【図937】

【図938】

【図939】

【図940】

【図941】

【図942】

【図943】

【図944】

【図945】

【図946】

【図947】

【図948】

【図949】

【図950】

【図951】

【図952】

【図953】

【図954】

【図955】

【図956】

【図957】

【図958】

【図959】

【図960】

【図961】

【図962】

【図963】

【図964】

【図965】

【図966】

【図967】

【図968】

【図969】

【図970】

【図971】

【図972】

【図973】

【図974】

【図975】

【図976】

【図977】

【図978】

【図979】

【図980】

【図981】

【図982】

【図983】

【図984】

【図985】

【図986】

【図987】

【図988】

【図989】

【図990】

【図991】

【図992】

【図993】

【図994】

【図995】

【図996】

【図997】

【図998】


【図999】

【図1000】



(6)サマリー表示機能

～画面例 (US公開特許サマリー)～

《USサマリー》  5

US 20150000001A1

(10) United States
(12) Patent Application Publication
Jackson, SR.

(10) Pub. No.: US 2015/0000001 A1
(43) Pub. Date: Jan. 1, 2015

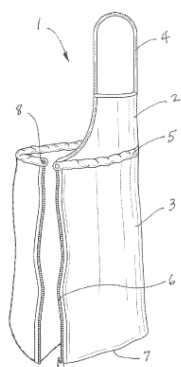
(54) APRON HAVING ELASTIC WAIST AND ZIP CLOSURE
(71) Applicant: Monroe Jackson, SR., Jackson, MS (US)
(72) Inventor: Monroe Jackson, SR., Jackson, MS (US)
(21) Appl. No.: 14/486,383
(22) Filed: Sep. 15, 2014

Related U.S. Application Data
(63) Continuation-in-part of application No. 29/395,273, filed on Dec. 27, 2011, now Pat. No. D,713,131.

Publication Classification
(51) Int. Cl. A41D 13/04 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)

(52) U.S. CL. CPC A41D 13/04 (2013.01); A41D 13/00 (2013.01)
USPC 252

(57) ABSTRACT
An hands-free, string-less apron is provided, comprising upper and lower sections constructed from a flexible material, such as a fabric or plastic material. The upper section includes a neck strap for resting behind the neck of a wearer, and the upper section is intended to cover the abdomen of the wearer. The lower section is attached to the upper section, and the upper and lower sections are separated by an elastic waist band extending along the top edge of the lower section. The lower section completely surrounds the waist and legs of the wearer when in a closed configuration. The lower section includes a closure device, such as zipper, extending substantially vertically between the elastic waist band and the bottom edge of the lower section. Optionally, a snap fastener is also located on the waist band to assist in closing the apron around the wearer.



2015/0000001

CLAIM(S)
1. An apron constructed from a flexible material, comprising (a) an upper section shaped and dimensioned to substantially cover the abdomen of a wearer, (b) a lower section operatively attached to the upper section, wherein the lower section has a bottom edge extending below the knees of a wearer, and wherein the lower section is shaped and dimensioned to completely surround the waist and legs of the wearer when in a closed configuration, (c) an elastic waist band connected between the upper section and the lower section, wherein the elastic waist band completely surrounds the waist of the wearer when in a closed configuration, (d) a neck strap extending from the upper section adapted to rest behind the neck of the wearer, and (e) a closure device extending substantially vertically between the elastic waist band and the bottom edge, wherein the closure device is adapted to close the lower section.

2. The apron of claim 1, further including a fastener on the elastic waist band adapted to close the elastic waist band.
3. The apron of claim 2, wherein the fastener is a snap device.
4. The apron of claim 1, wherein the elastic waist band is an elastic fabric stretched between the upper section and the lower section.
5. The apron of claim 1, wherein the closure device is a zipper.
6. The apron of claim 1, wherein the flexible material is a fabric.
7. The apron of claim 6, wherein the fabric is water repellent.
8. The apron of claim 1, wherein the flexible material is a plastic sheeting material.

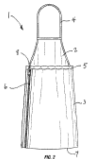


FIG. 1

FIG. 2

© HUSSEY FASHION CO., LTD.



検索クエリ—指定方法の改善

～機能説明～

Japio-GPG/FXの検索手法として、項目検索と検索クエリの2種類の指定方法があります。

検索クエリでは検索タームコードと検索タームを組み合わせて複雑な検索式が作成できますが、項目検索と指定方法が異なる点や、演算子の指定に煩雑な点がある事などを改善し、指定が容易になるように改善いたしました。

①検索ターム指定の簡略化

【従来】TI:インクジェット AND TI:プリンタ ⇒ 【新規】TI:(インクジェット AND プリンタ)

②演算子指定の簡略化(AND→スペース、OR→+、NOT→-)

【従来】TI:インクジェット AND TI:プリンタ ⇒ 【新規】TI:インクジェット TI:プリンタ または
TI:(インクジェット プリンタ)

※【従来】の指定も可能です。



ハイライト機能の改善

～機能説明～

Japio-GPG/FXでは「Word-INDEXの用語検索項目」ではハイライトされませんでした。が、ハイライトするように改善しました。

これにより、近傍検索時やファセットでの絞りこみ時などで指定した用語がハイライトするようになりました。

※「Word-INDEXの用語検索項目」は以下の通りです。

TI_F(タイトル)、AB_F(要約)、CL_F(クレーム)、DS_F(詳細な説明)

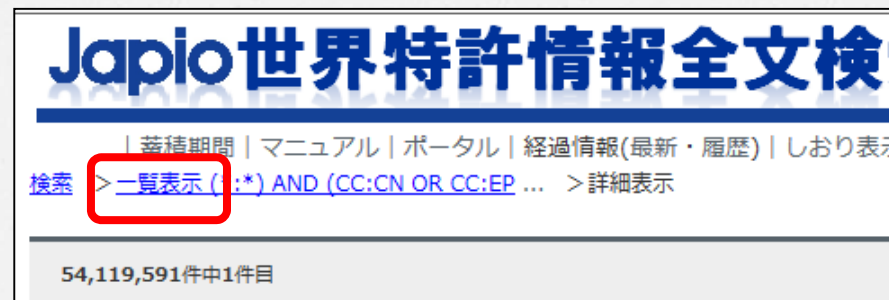


表示機能の改善

～機能説明&画面例～

詳細表示画面から一覧表示に戻る際のリンクが分かりにくいとの指摘
がございましたので、改善を実施しました。

一覧表示へのリンクは「検索式」となっていた部分を「**一覧表示** 検索
式」に修正しました。





ドイツ・フランス公報全文英語データの追加 ～機能説明&画面例～

7/17リリース

ドイツ公報・フランス公報の全文英語データを追加します。

(1976年以降の独英・仏英機械翻訳データです。)

今後、PCT公報とEP公報の独英・仏英機械翻訳データおよび各々の英日機械翻訳データを順次追加いたします。

[de]Flusseinstellvorrichtung

[DE] Flow Adjusting Device

出願人: (DISCO CORP(DISCO CORPORATION))

発明者: (SUNAGAWA TAKESHI(SUNAGAWA, TAKESHI))

出願番号: (DE201410212453) [2014-06-27]

文献番号: DE102014212453A1 (DE102014212453A1) [2014-12-31] [公報PDF](#) [フロントPDF](#)

I P C : (F16L25/14)

E C L A :

C P C : F16K7/04; Y10T137/87877

優先権主張番号: JP20130136273

英語／中国語	日本語
<invention-title>	【発明の名称】
[de]Flusseinstellvorrichtung	
[DE]Flow Adjusting Device	
<abstract>	【要約】
[de]Eine Flusseinstellvorrichtung zum Einstellen der Flussrate eines in mehreren Röhren fließenden Fluids wird bereitgestellt. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet eine Röhrenkopplungsverbindung mit einem Verbindungskörper und mehreren Eingriffsvorsprüngen. Der Verbindungskörper weist mehrere Verbindungsöffnungen zum jeweiligen Verbinden der Röhren auf. Die Eingriffsvorsprünge sind an den inneren Umfangsoberflächen der Verbindungsöffnungen des Verbindungskörpers angebracht und wirken so, dass sie jeweils mit den äußeren Umfangsoberflächen der Röhren in Eingriff stehen. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet ferner mehrere innere Hülsen, die äußere Durchmesser aufweisen, die jeweils den inneren Durchmessern der Röhren entsprechen, und dafür ausgelegt sind, jeweils in die vorderen Endabschnitte der Röhren eingepasst zu werden. Die inneren Hülsen wirken so, dass sie die Eingriffskräfte der Eingriffsvorsprünge, die auf die äußeren Umfangsoberflächen der in die Verbindungsöffnungen der	

16



ドイツ・フランス公報全文英語データの追加 ～画面例～

7/17リリース

<description>	【詳細な説明】
BACKGROUND OF THE INVENTION	
Field of the invention	
[0001] a flow adjusting device for adjusting the flow rate of a fluid The present invention relates to, the flows in several tubes.	
Description of the state of the type	
[0002] In be more than roads designated a semiconductor device-Fabrication method, at the front of a substantially disk-like semiconductor wafer formed intersecting dividing lines, a plurality of regions to be formed thereby to divide , in each of which a plurality of components, such as ICs and LSIs,. The back surface of the semiconductor wafer is ground with a grinding device, so as to reduce the thickness of the semiconductor wafer to a predetermined thickness. Afterwards the semiconductor wafer along the streets Terminating with a cutting device or a laser processing device, to obtain thereby the individual components which are separated from one another.	
[0003] The grinding device for grinding the backside of a wafer, such as a semiconductor wafer, includes a chuck table for holding said wafer under suction, an abrasive with a grinding wheel for grinding the wafer held on the chuck table, wherein the grinding wheel is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the abrasive ground (see e.g. the exposed JP2005-153090).	
[0004] a chuck table Cutting device for separating a wafer into the individual components The includes for holding the wafer under suction, a cutting means having a cutting blade for cutting the wafer held on the chuck table, wherein the cutting blade is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the cutting means cut (see e.g. the exposed JP2001-7058).	

日本語データは
今後追加予定です。